PAT-NO:

JP02000169186A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000169186 A

TITLE:

CRYSTALLIZED GLASS FOR INFORMATION

RECORDING DISK

PUBN-DATE:

June 20, 2000

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUU, GAKUROKU AZEGAMÍ, KOJI

N/AN/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HOYA CORP

N/A

APPL-NO:

JP10343983

APPL-DATE:

December 3, 1998

INT-CL (IPC): C03C010/14, G11B005/73

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To inexpensively produce a crystallized glass and a crystallized glass substrate having a high Young's modulus, high strength and heat resistance and excellent in surface smoothness and surface homogeneity and to obtain an information recording disk such as a magnetic disk.

SOLUTION: The crystallized glass for an information recording disk contains, by mol, 35-55% SiO2, 0 to <5% Al2O3 (SiO2+Al2O3&ge;40%), 25-45% MgO, 0.5-8%Y2O3, 0-10% ZrO2 and 0-12% TiO2 (4.5%≤ZrO2+TiO2 ≤18%) and has

enstatite and/or a β-quartz solid solution as the predominant crystal phase. The crystallized glass substrate for an information recording disk comprises the glass and the surface on which an information recording layer is formed has 0.1-1.0 nm surface roughness Ra. The information recording medium has the glass substrate and a recording layer formed on the glass substrate. The magnetic disk has the glass substrate and a magnetic recording layer formed on the glass substrate.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-169186 (P2000-169186A)

(43)公開日 平成12年6月20日(2000.6,20)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI

テーマコート\*(参考)

C 0 3 C 10/14

G11B 5/73

C 0 3 C 10/14

4G062

G11B 5/704

5 D 0 0 6

#### 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平10-343983

(71)出願人 000113263

ホーヤ株式会社

(22)出願日

平成10年12月3日(1998.12.3)

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

(72)発明者 郷 学禄

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホー

ヤ株式会社内

(72)発明者 畔上 幸士

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホー

ヤ株式会社内

(74)代理人 100092635

弁理士 塩澤 寿夫 (外1名)

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 情報記録ディスク用結晶化ガラス

### (57)【要約】

【課題】 高いヤング率を有する結晶化ガラスであって、強度、耐熱性が高く、表面平滑性や表面均質性に優れ、かつ安価に製造できる結晶化ガラス及び結晶化ガラス基板の提供、並びに磁気ディスク等の情報記録用ディスクの提供。

【解決手段】 Si02:35-55モル%、AI208:0モル%以上、5モル%未満、但し、Si02+AI208  $\ge$  40モル%、M80:25-45モル%、Y203:0.5-8  $\ge$  10  $\times$  10  $\times$ 

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 SiO2:35-55モル%、Al2O3:0モル %以上、5モル%未満、但し、SiO2+Al2O3≥40モル%、 MgO: 25-45モル%、Y203: 0.5-8モル%、ZrO 2:0-10モル%、TiO2:0-12モル%但し、ZrO2+Ti 02:4.5-18モル%を含有し、主結晶相がエンスタ タイト及び/又はβ-石英固溶体であることを特徴とす る情報記録ディスク用結晶化ガラス。

【請求項2】 Li<sub>2</sub>0:0-5モル%、Na<sub>2</sub>0:0-5モル% 及びK2O:0-5モル%をさらに含有し、かつLi2O+Na2O+ 10 K20≤5モル%である請求項1に記載のガラス。

【請求項3】 Ca0:0-10モル%、Sr0:0-10モル%、 BaO: 0-10モル%、ZnO: 0-10モル%、NiO: 0-10モル %をさらに含有し、かつCaO+SrO+BaO+ZnO+NiO≤10モル %である請求項1または2に記載のガラス。

【請求項4】 B203:0-5モル%、P205:0-5モル%、 R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 0-5モル%(但し、Rは希土類金属イオンであ る)、CeO2:0-5モル%、N2O5:0-5モル%(但し、N はNbまたはTaである)をさらに含有し、かつB2O3+P2O5+ R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+CeO<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>≤5モル%である請求項1~3のいずれ 20 か1項に記載のガラス。

【請求項5】、As203:0-2モル%、Sb20a:0-2モル% をさらに含有し、かつAs2O3+Sb2O3≤2モル%である請 求項1~4のいずれか1項に記載のガラス。

【請求項6】 結晶相の結晶粒子サイズが、表面粗さRa が0.1-1.0nmの範囲となるように研磨表面を形成できる 程度であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1 項に記載のガラス。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項に記載のガ ラスからなり、かつ情報記録層を形成するための表面が 30 0.1-1.0nmの範囲の表面粗さRaを有することを特徴とす る情報記録ディスク用結晶化ガラス基板。

【請求項8】 請求項7に記載のガラス基板と、該ガ ラス基板上に形成された記録層とを有することを特徴と する情報記録媒体。

【請求項9】 請求項7に記載のガラス基板と、該ガ ラス基板上に形成された磁気記録層とを有することを特 徴とする磁気ディスク。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク基板 や各種電子部品用基板に適した結晶化ガラス及びこの結 晶化ガラスを用いたガラス基板に関する。さらに詳しく は、本発明は、高いヤング率、優れた機械強度、表面平 坦性及び耐熱性を有し、かつ研磨加工することにより優 れた表面平滑性を有するガラス基板を提供できる結晶化 ガラス及びこの結晶化ガラスを用いた優れた表面平滑性 を有するガラス基板に関する。さらに本発明は、上記ガ ラス基板を用いた情報記録媒体及び磁気ディスクに関す る。

[0002]

【従来の技術】コンピューターなどの磁気記憶装置の主 要構成要素は、磁気記録媒体と磁気記録再生用の磁気へ ッドである。磁気記録媒体としてはフレキシブルディス クとハードディスクとが知られている。このうちハード ディスク用の基板材料としては主としてアルミニウム合 金が使用されてきている。最近、ノートパソコン用ハー ドディスクドライブの小型化や磁気記録の高密度化にと もなって磁気ヘッドの浮上量が顕著に減少してきてい る。これに伴い、磁気ディスク基板の表面平滑性につい て、きわめて高い精度が要求されてきている。しかし、 アルミニウム合金の場合には、硬度が低いことから高精 度の研磨材及び工作機器を使用して研磨加工を行って も、この研磨面が塑性変形するので、ある程度以上高精 度の平坦面を製造することは困難である。また、ハード ディスクドライブの小型化・薄型化に伴い、磁気ディス ク用基板の厚みを小さくすることも要求されている。し かし、アルミニウム合金は、強度、剛性が低いので、ハ ードディスクドライブの仕様から要求される所定の強度 を保持しつつ、ディスクを薄くすることは困難である。 【0003】そこで、アルミニウム合金基板に代わっ て、高強度、高剛性、高耐衝撃性、高表面平滑性を必要 される磁気ディスク用ガラス基板が登場してきた。この うち、基板表面をイオン交換法で強化した化学強化ガラ ス基板(例えば、特開平1-239036号公報参照) や、結晶化処理を施した結晶化基板(例えば、米国特許 5391522公報、米国特許5476821公報参照)などが よく知られている。特開平1-239036号公報に記 載のイオン交換強化ガラス基板は、重量%表示で、Si  $0_2:50-65\%$ ,  $Al_2O_3:0:5-14\%$ ,  $R_2O$  (ただ しRはアルカリ金属イオン):10-32、Zn0:1-1.5%、B2O3:1.1-14%を含むガラス基板の表面 に、アルカリイオンによるイオン交換法によって圧縮応 力層形成し強化された磁気ディスク用ガラス基板であ る。また、米国特許5391522公報に記載の結晶化 ガラスは、重量%表示で、SiO2:65-83%、Li2O: 8-13%,  $K_20:0-7\%$ , Mg0:0.5-5.5%, ZnO: 0-5%、PbO: 0-5% (ただしMgO+ZnO+ PbO: 0.5-5%)  $P_2O_5: 1-4\%$ ,  $Al_2O_3: 0-7\%$ ,  $As_2$ 40 03+Sb203:0-2%を含み、主結晶として微細なLi20・ 2SiO2結晶粒子を含む磁気ディスク用結晶化ガラスであ る。米国特許5476821公報には、重量%表示でSiO2:35-60%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 20-35%、MgO: 0-25%、ZnO: 0-25%、但 L. MgO+ZnO>10%, TiO<sub>2</sub>: 0-20%, ZrO<sub>2</sub>: 0-10%, Li<sub>2</sub>O: 0-2%、NiO:0-8%、但しTiO2+ZrO2+NiO>5%などの酸 化物成分を含み、主結晶としてスピネル結晶粒子を含む ディスク用結晶化ガラスが開示されいる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、最近の 50 ハードディスクの小型化、薄型化、記録の高密度化に伴 って、磁気ヘッドの低浮上化及びディスク回転の高速化 が急速に進み、そのため、ディスク基板材料の強度やヤ ング率、表面平滑性などが一層厳しく要求されてきてい る。特に最近パソコン及びサーバー用3.5インチハード ディスク情報記録の高密度化によって基板材料の表面平 滑性及び表面平坦性が厳しく要求され、またデータ処理 の高速化に対応してディスクの回転数を10000rpm以上に する必要があるため、基板材料の剛性度に対する要求が 一層厳しくなってきており、従来のアルミ基板の限界が すでにはっきりとなっている。今後、ハードディスクの 10 高容量化、高速回転化の需要が必然であるかぎり、磁気 記録媒体用基板材料としては高ヤング率、高強度、優れ た表面平坦性、耐衝撃性などが強く要求されつつあるに 間違いない。

【0005】そのため、特開平1-239036号公報 に開示されているような化学強化ガラスでは、ヤング率 が約80Gpa程度で今後のハードディスクの厳しい要求に 対応できなくなるのは明らかである。また、イオン交換 による化学強化を施したガラスには多量のアルカリ成分 含まれるため、高温、多湿環境下において長時間使用す ると磁気膜のピンホール部または磁気膜の周辺部など磁 気膜が薄い部分またはガラスが露出した部分からアルカ リイオンが析出し、これが引き金となって磁気膜が腐食 或いは変質するなどの欠点が見出されている。また、こ れまでのイオン交換強化基板ガラスはイオン交換のため 多量のアルカリイオンをガラスに導入しており、そのた めほとんどの強化ガラスのヤング率が低く(100Gpa)、剛 性度も低いので、3.5インチのハイエンドディスク基板 や薄型化ディスク基板に対応できないという欠点があ る。さらに磁気記録媒体の製造過程においては、ガラス 30 基板上に磁気層を設けた後に、磁気層の保磁力などの特 性を向上させるために所定の熱処理を施する場合がある が、上記従来のイオン交換強化ガラスではガラスの転移 温度もせいぜい500℃程度で耐熱性に乏しいので、高 保磁力が得られないという問題がある。

【0006】また、米国特許5391522公報に開示 されているような従来の結晶化ガラスは、ヤング率や耐 熱性の点では、上記の化学強化ガラス基板より少々優れ ている。しかるに、表面粗さは10オングストロームより大き く表面平滑性が乏しいので、磁気ヘッドの低浮上化に限 40 界があるため、磁気記録の高密度化に対応できないとい う問題がある。さらに、ヤング率もせいぜい90-100Gpa 程度で3.5インチハイエンドディスク基板や薄型化ディ スク基板に対応することができないという欠点もある。 また、米国特許5476821公報に開示されている磁気ディ スク用結晶化ガラスは140Gpa程度の高いヤング率をもつ ものの、スピネルを主結晶となるので溶解温度や液相温 度が高い上、硬度の高いスピネル結晶と母体ガラスとの 硬度差が大きすぎて研磨し難いという欠点がある。この ような高ヤング率結晶化ガラスを安価的に製造するのは 50 してよく知られているSiO2-AI2O3-MgO系S-ガラスでもせ

難しく、採算性も悪いので、大量製造に相応しくない。 【0007】そこで本発明の目的は、磁気ディスク等の 情報記録用ディスクに用いることができる高いヤング率 を有する結晶化ガラスであって、強度、耐熱性が高く、 表面平滑性や表面均質性に優れ、かつ安価に製造できる 結晶化ガラスを提供することにある。さらに本発明の目 的は、高いヤング率を有し、強度、耐熱性が高く、表面 平滑性や表面均質性に優れ、かつ安価に製造できる結晶 化ガラスからなる、磁気ディスク等の情報記録用ディス クに用いることができるガラス基板を提供することにあ る。また、本発明の目的は、上記結晶化ガラス基板を用 いた情報記録媒体及び磁気ディスクを提供することにあ る。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本発明の高ヤング率結晶化ガラスは、エンスタタイ ト及びβ-石英固溶体結晶の一方又は両方の結晶を含む ことを特徴とする。最近、HDDの小型化、高容量化、 高速化に伴って、将来の磁気記録媒体用基板の厚みは、 恐らく現在3.5インチの0.8mmから0.635mmへと、2.5イン チの0.635mmから0.43mmさらに0.38mmへと薄くなり、基 板の回転速度も現在の最高速度の10000rpmから15000rpm へと高速回転化すると予測されている。このような磁気 記録媒体用基板は薄くなればなるほど、基板のたわみや うねりや反りが生じしやくなり、また高速回転すればす るほど基板の受ける応力(回転によって生じる風圧に基 づくディスクに働く力) が大きくなることが予想でき る。力学の理論に基づけば、円板が高速回転するときの たわみは以下の式で表される。

[0009]

【式1】

$$w \propto \frac{(rpm)^2 a^4}{h^3 E \Omega}$$

【0010】ここで、rpmは円盤の回転速度、aは円盤の 外円半径、hは円盤の厚み、Eは円盤材料のヤング率、 Ωは円盤材料のダンピングファクターである。この式か ら、高速回転化基板のたわみを押さえるためにはヤング 率Eの高い基板材料が必要となることが分かる。基板材 料のヤング率Eが高ければ高いほど基板の剛性度が高く なるだけでなく、基板の耐衝撃性も強度もともに大きく なる。そのため、高い比弾性率及び大きなヤング率を持 つガラス材料がHDDの市場から強く要求されている。 しかしながら、現在のところ、100Gpa以上のヤング率を 持ち、高い耐熱性及び優れた表面平滑性 (表面粗さく5 オングストローム)を有し、かつ安価に大量製造できる 酸化物ガラスは市場ではまだ見当たらない。

【0011】これまで市販の高ヤング率酸化物ガラスと

いぜい80-90 Gpa程度のヤング率しか持たない。そこで、本発明者らは140Gpa以上のヤング率をもつ結晶化ガラス材料の提供を目的とし、鋭意研究を重ねた。その結果、MeO-SiO2系ガラスにおいて、Y2Ok、TiO2、ZrO2、Al2O3を必須成分として含有させた原ガラスを適当な温度範囲で熱処理することによりβ-石英固溶体やエンスタタイトなどの微細な結晶粒子を析出させた結晶化ガラスが140-200Gpaの高いヤング率をもち、優れた機械強度、表面平滑性、表面平坦性、耐熱性を有し、容易に成形することができること、さらには得られた結晶化ガラス基板は容易に研磨加工することができ、かつ磁気ディスク基板としての化学的物性に優れることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0012】本発明は、SiO2:35-55モル%、Al2O3:0モル%以上、5モル%未満、但し、SiO2+Al2O3≥40モル%、MgO:25-45モル%、Y2O3:0.5-8モル%、ZrO2:0-10モル%、TiO2:0-12モル%但し、ZrO2+TiO2:4.5-18モル%を含有し、主結晶相がエンスタタイト及び/又はβ-石英固溶体であることを特徴とする情報記録ディスク用結晶化ガラスに関する。さらに本発明は、上記結晶化ガラスからなる情報記録ディスク用基板並びにこの基板を用いた情報記録媒体及び磁気ディスクに関する。

### [0013]

【発明の実施の形態】本発明の結晶化ガラスの組成は、 原ガラスと同様に酸化物基準で表示する。以下に原ガラ スの組成範囲を上記のように限定した理由について以下 に述べる。尚、本明細書中、「%」は特に断らない限り 「モル%」である。SiO2はガラスの網目構造の形成物で あり、主な析出結晶であるエンスタタイトやβ-石英固 30 溶体の構成成分でもある。SiO₂の含有量が35%未満では 溶解したガラスが非常に不安定なので、高温成形ができ なくなる傾向があるうえ、上記のような結晶も析出し難 しくなる。また、SiO₂の含有量が35%より少なくなる と、残存ガラスマトリックス相の化学耐久性が悪化した り、耐熱性も悪化する場合もある。一方、SiO2の含有量 が55%を超えると、ガラスのヤング率が急激に小さくな る傾向がある。そこで、析出結晶種及びその析出量、化 学耐久性、耐熱性及び成形・生産性を考慮すると、SiO2 の含有量の下限は35%であり、上限は55%である。SiO₂の 40 含有量の下限は、好ましくは37%であり、より好ましく は40%である。また、SiO2の含有量の上限は、好ましく は54%であり、より好ましくは53%である。

【0014】Al20sはガラスの中間酸化物であり、主な結晶種のβ-石英固溶体の構成成分でもある。Al20sの導入は準安定なβ-石英固溶体結晶の析出を促進し、ガラス表面硬度の向上に寄与する。しかし、Al20sの含有量が 5%以上であると、溶融温度や液相温度が高くなってガラスが溶けにくくなるうえ、成形しにくくなる。そこで、Al20sの含有量は5%未満とする。ガラスの溶解

性、高温度成形性、析出結晶種などのことを考慮すると、Al203の含有量の下限は、好ましくは0%であり、より好ましくは1%である。Al203の含有量の上限は、好ましくは4.5%であり、より好ましくは4%である。尚、上記のようにAl203は必ずしも含有されなくても良いが、ガラスに十分な化学耐久性、量産可能な熱的安定性を付与するという観点から、Si02とAl203との合計含有量(Si02+Al203)は40モル%以上とする。そのため、Al203が含有されない場合、Si02の含有量は40モル%以上とする。また、Si02とAl203との合計含有量は、好ましくは42モル%以上である。

【0015】MgOはSiO2成分とともに原ガラスの熱処理によりエンスタタイト結晶を生成し、硬度や耐熱性を向上しつつ透明性を維持させる効果を有する成分である。MgOの含有量が25%未満では上記のような効果は得られない。そこで、MgOの含有量は25%以上とする。一方、MgOの含有量が45モル%を超えると、ガラスの高温粘性が急激に低くなって熱的に不安定となり、生産性や加工性も悪化する傾向がある。そこで、MgOの含有量は45%以下とする。MgOの含有量は、ガラスの生産性、化学耐久性、高温粘性及び強度などのことを考慮すると、下限は25%であり、上限は45%である。下限は、好ましくは28%、より好ましくは32%であり、上限は好ましくは43%、より好ましくは42%である。

【0016】本発明の結晶化ガラスは、Y203を含有す る。少なくとも0.5%のY2Csを導入することによって結晶 化ガラスのヤング率を5Gpa程度増大させ、かつ液相温 度を50℃程度低減することができる。さらに、少なくと も0.5%のY2O3を導入することによってガラスの熱的な安 定性を向上させることもできる。このように、少量のY2 Osを導入することによってガラスの特性や生産性を格段 に向上させることができる。しかし、Y2O3は上記のガラ ス主結晶の核生成を抑制する作用も有するので、Y2O3の **導入量が多くなり過ぎると、ガラスは熱処理中で表面結** 晶化を起こし、目標とする表面平滑性を有する結晶化ガ ラスが得難くなる傾向がある。そこで、Y2O3の含有量を 8%以下とする。Y20gの含有量の下限は、好ましくは0.5 %であり、より好ましくは1%である。Y2O3の含有量の上 限は、好ましくは5%であり、より好ましくは3%である。 【 O O 1 7 】 Ti O₂ と ZrO₂ は結晶核の生成剤としてβ−石 英固溶体やエンスタタイトなどの結晶粒子の析出に欠か せない成分であり、また、SiO2の含有量が少ない時、ガ ラスの熱的な安定性を持たせる成分でもある。TiOzとZr 02の合計含有量が4.5%未満では、主結晶の核生成剤とし て十分に作用しないため、ガラスが表面結晶化を起こ し、均質な結晶化ガラスの作製が困難となる。そこで、 TiO<sub>2</sub>とZrO<sub>2</sub>の合計含有量は4.5%以上とする。しかし、T iO2とZrO2の合計含有量が18%を超えると、ガラスの高温 粘性が低くなりすぎて分相したり、失透したりするの 50 で、ガラスの生産性は極端に悪化してしまう傾向があ

る。そこで、TiO2とZrO2の合計含有量は18%以下にす る。ガラスの生産性、化学耐久性、高温粘性、結晶核生 成などのことを考慮すると、TiO2とZrO2の合計含有量の 下限は4.5%であり、上限は18%である。TiO2とZrO2の合 計含有量の下限は、好ましくは5%であり、上限は、好ま しくは15%である。但し、ガラスの高温溶融性や熱的な 安定性を考慮すると、ZrO2の含有量は0~10モル%の 範囲とし、TiO2の含有量は0~12モル%の範囲とする ことが適当である。

【0018】本発明の結晶化ガラスは、主結晶相として β-石英固溶体及びエンスタタイトの一方または両方を 含有する。β-石英固溶体の結晶相は、2MgO·2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·5S iO2、MgO·Al2O3·3SiO2、及びMgO·Al2O3·4SiO2からなる 群から選ばれる1種又は2種以上の組成を有するが準安 定なクオーツ(石英固溶体)である。また、エンスタタ イトの結晶相は、例えば、Mg2Si2 O6 の組成を有するク リノエンスタタイト結晶相であることができる。

【0019】さらに、本発明の結晶化ガラスに含まれる 上記結晶の結晶粒子サイズは、本発明の結晶化ガラスを 表面粗さRaが0.1-1.0nmの範囲となるように研磨表面を 形成できる程度であることが好ましく、より好ましくは 結晶相の結晶粒子サイズが、表面粗さRaが0.1-0.5nmの 範囲となるように研磨表面を形成できる程度である。結 晶化ガラスに含まれる結晶相の結晶粒子サイズが上記範 囲となることで、優れた表面平滑性を有する情報記録デ ィスクを提供することができる。

【0020】Li20、Na20、K20などのアルカリ金属酸化 物はガラスの液相温度を下げ、結晶粒子をより細かく析 出させるために添加される成分である。例えば約2%程度 のLi2OをMgO-Al2O3-SiO2-TiO2ガラスに導入すると、 ガラスのヤング率がほとんど変わらないのに対し、結晶 粒子の大きさはLi20を添加しないガラスと比べ約半分以 下となる。また、Li2O、Na2O、K2Oはガラスの液相温度 を下げる役割も大きく、2%程度のアルカリ金属酸化物の 導入でガラスの液相温度を約50℃程度下げることができ る。しかし、Li20などのアルカリ成分の含有量が多過ぎ ると、ガラスのヤング率は下がり、失透傾向が大きくる など、ガラスの生産性を著しく悪化させる傾向がある。 そのため、Li20、Na20及びK20の合計導入量は5%以下 とする: Li<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O及びK<sub>2</sub>Oの合計導入量は、より好ま しくは4%以下である。

【0021】CaO、SrO、BaO、ZnO、NiOなどのアルカリ 土類金属酸化物成分は、主にガラス高温粘性を調整し、 失透傾向を抑え、結晶粒子を均質化することができる成 分である。これらの成分の少なくとも1つをガラスに添 加することで、ガラスのヤング率は多少小さくなるが、 ガラスの生産性が向上し、結晶化粒子のサイズが均質化 するなど、ガラスの他の特性を改善することができる。 ガラスのヤング率、生産性、結晶化ガラスの表面平滑

の範囲、Sr0の含有量は0-10%の範囲、Ba0の含有量は0 -10%の範囲、Zn0の含有量は0-10%の範囲、Ni0の含 有量は0-10%の範囲であり、かつCaO+SrO+BaO+ZnO+NiO の含有量は10モル%以下であることが好ましい。さら に、CaO、SrO、BaO、ZnO、NiO及びCaO+SrO+BaO+ZnO+NiO の含有量は、いずれも好ましくは8%以下である。

【0022】本発明の結晶化ガラスは、上記の成分の他 に、所望の特性を損なわない範囲でB2O3、P2O5、Nb 20s、Ta20s、及びLa203等の希土類金属酸化物成分を含 有することができる。しかし、これらの成分は著しくガ ラスのヤング率を低下させる。そこで、B2O3の含有量は 0-5%の範囲、P205の含有量は0-5%の範囲、R203の含 有量は0-5%の範囲(但し、Rは希土類金属イオン(例 えば、Nd3+、Pr3+、Pm3+、Sm3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Dy <sup>3+</sup>、Ho<sup>3+</sup>、Er<sup>3+</sup>、Tm<sup>3+</sup>、Yb<sup>3+</sup>)である)、CeO<sub>2</sub>の含有量 は0-5%の範囲、N2Osの含有量は0-5%の範囲(但し、 NはNbまたはTaである)とし、かつB2O3+P2O5+R2O3+CeO 2+N2O5≦5モル%であることが好ましい。さらに、ガラ スの生産性を考慮すると、上記各成分の含有量及び合計 の含有量は4%以下にすることがさらに好ましい。

【0023】Asa OaとSba Oaは、結晶化ガラスの原料とな るガラスの均質化を図るために脱泡剤として添加される 成分である。各ガラスの高温粘性に応じて適当量のAs20 3及びSb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の一方又は両方をガラスに添加することで、 より均質なガラスが得られる。しかし、これら脱泡剤の 添加量が多くなり過ぎると、ガラスの比重が上昇してヤ ング率を低下させる傾向があり、また溶解用白金るつぼ と反応してるつぼにダメージを与える恐れもある。そこ で、As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の含有量は0-2%の範囲、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の含有量は0 -2%の範囲とし、かつAs203+Sb203≤2モル%とするこ とが好ましい。特に、As2O3、Sb2O3及びAs2O3+Sb2O3の 含有量は、いずれも1.5%以下であることが好ましい。 【0024】本発明の結晶化ガラスの製造方法は、特に 限定されず、各種ガラス製造方法を用いて得られたガラ スを熱処理することで結晶化ガラスを得ることができ る。例えば、高温溶融法、即ち所定の割合のガラス原料 を空気中または不活性ガス雰囲気で溶解し、バブリング や脱泡剤の添加や撹拌などによってガラスの均質化を行 い、周知のプレス法、フロート法やダウンドーロ成形な どの方法により板ガラスに成形され、その後、研削、研 磨などの加工を施し、所望のサイズ、形状のガラス成形 品とすることができる。得られたガラス成形品の熱処理 方法には、特に制限はなく、結晶化促進剤の含有量やガ ラスの転移温度、結晶化ピーク温度などに応じて選択す ることができる。但し、始めに比較的に低い温度で熱処 理して多数の結晶核を発生させた後、温度を上げて結晶 を成長させることが、微細な結晶を得るうえで好まし い。適当な条件での熱処理により結晶粒子のサイズが10 -1000 n m範囲にある β 石英固溶体やエンスタタイトの 性、強度などの特性を考慮するとCaOの含有量は0-10% 50 一方または両方を含む結晶化ガラスが得られる。

【0025】熱処理を終えた成形品は常法を用いて表面 を研磨することができる。研磨方法については特に制限 がなく、合成ダイヤモンド、炭化珪素、酸化アルミニウ ム、炭化ホウ素などの合成砥粒や、天然ダイヤモンド、 酸化セリウムなどの天然砥粒を用いて、公知の方法によ り研磨することができる。例えば、通常の研磨方法およ び装置でラッピングおよび酸化セリウムにてポリシング 加工することによって、表面粗さ(Ra)を0.1-1.0n mの範囲にした結晶化ガラス基板を得ることができる。 【0026】このようにして得られる本発明の結晶化ガ ラスは、情報記録ディスク用として好適である。本発明 の結晶化ガラスを用いた磁気ディスク基板は、磁気ディ スク基板として必要な表面平滑性、平坦性、強度、硬 度、化学耐久性、耐熱性などをすべて満足する。また、 従来の結晶化ガラス (Li20-Si02結晶化ガラス) に比 べ、1.5倍以上の高いヤング率をもつので、ディスクの 高速回転化によるたわみをより小さく抑えることがで き、高TPIハードディスクの実現のため基板材料として 好適である。

【0027】本発明の結晶化ガラスを製造するに際して、熱処理のスケジュールやガラス組成を適宜変えることにより、析出結晶サイズや結晶量を制御することができ、必要に応じて結晶化ガラスの特性を大幅に調整することができる。

【0028】本発明の結晶化ガラスを製造するに際して、熱処理のスケジュールやガラス組成を適宜変えることにより、析出結晶サイズや結晶量を制御することができ、必要に応じて結晶化ガラスの特性を大幅に調整することができる。

【0029】次に、本発明の情報記録媒体について説明する。本発明の情報記録媒体は、本発明の情報記録媒体 用ガラス基板と、該ガラス基板上に形成された記録層と を有することを特徴とする。ここで、「ガラス基板上に 形成された記録層」とは、ガラス基板表面に直接または 所望の層を介して形成された単層構造または複数層構造 の記録層を意味し、当該記録層の材料及び層構造は、目 的とする情報記録媒体の種類に応じて、磁気記録層、光 記録層、光磁気記録層等として機能するよう適宜選択さ れる。

【0030】次に、本発明の磁気ディスクについて説明 40 する。本発明の磁気ディスクは、本発明のガラス基板と、このガラス基板上に形成された磁気記録層とを有することを特徴とする。上述した本発明のガラスからなる基板の主表面に、少なくとも磁性層を形成した磁気ディスク(ハードディスク)ものについて以下に説明する。磁性層以外の層としては、機能面から、下地層、保護層、潤滑層、凹凸制御層などが挙げられ、必要に応じて形成される。これらの各層の形成には各種薄膜形成技術が利用される。磁性層の材料は特に制限されない。磁性層としては、例えば、Co系の他、フェライト系、供一条 50

土類系などが挙げられる。磁性層は、水平磁気記録、垂直磁気記録のいずれの磁性層でもよい。磁性層としては、具体的には、例えば、Coを主成分とするCoPt、CoCr、CoNi、CoNiCr、CoCrTa、CoPtCrやCoNiCrPt、CoNiCrTa、CoCrPtTa、CoCrPtSiOなどの磁性薄膜が挙げられる。また、磁性層を非磁性層で分割してノイズ低減を図った多層構成としてもよい。

【0031】磁性層における下地層は、磁性層に応じて選択される。下地層としては、例えば、Cr、Mo、Ta、Ti、W、V、B、AIなどの非磁性金属から選ばれる少なくとも一種以上の材料、又はそれらの金属の酸化物、窒化物、炭化物等からなる下地層等が挙げられる。Coを主成分とする磁性層の場合には、磁気特性向上の観点からCr単体やCr合金であることが好ましい。下地層は単層とは限らず、同一又は異種の層を積層した複数層構造とすることもできる。例えば、AI/Cr/CrMo、AI/Cr/Cr等の多層下地層等が挙げられる。

【0032】また、基板と磁性層の間又は磁性層の上部に、磁気へッドと磁気ディスクが吸着することを防止するための凹凸制御層を基板表面の一部又は全部に設けてもよい。この凹凸制御層を設けることによって、磁気ディスクの表面粗さは適度に調整されるので、磁気へッドと磁気ディスクが吸着することがなくなり、信頼性の高い磁気ディスクが得られる。凹凸制御層の材料及び形成方法は多種知られており、特に制限されない。例えば、凹凸制御層の材料としては、A1、Ag、Ti、Nb、Ta、Bi、Si、Zr、Cr、Cu、Au、Sn、Pd、Sb、Ge、Mgなどから選ばれる少なくとも一種以上の金属、又はそれらの合金、あるいは、それらの酸化物、窒化物、炭化物等からなる下地層等が挙げられる。形成が容易であるという観点からは、A1単体やA1合金、酸化A1、窒化A1といったA1を主成分とする金属であることが望ましい。

【0033】また、ヘッドスティクションを考慮すると、凹凸形成層の表面粗さは、Rmax=50~300オングストロームであることが好ましい。より好ましい範囲は、Rmax=100~200オングストロームである。Rm axが50オングストローム未満の場合、磁気ディスクが吸着し、磁気ヘッドや磁気ディスクが吸着し、磁気ヘッドや磁気ディスクが吸着し、磁気ヘッドや磁気ディスクが傷ついてしまったり、吸着によるヘッドクラッシュを起こすので好ましくない。また、Rmaxが300オングストロームを超える場合、グライド高さ(グライドハイト)が大きくなり記録密度の低下を招くので好ましくない。尚、凹凸制御層を設けずに、ガラス基板表面に、エッチング処理やレーザー光の照射等の手段で凹凸を付け、テクスチャリング処理を施してもよい。

層、潤滑層、凹凸制御層などが挙げられ、必要に応じて 形成される。これらの各層の形成には各種薄膜形成技術 が利用される。磁性層の材料は特に制限されない。磁性 層としては、例えば、Co系の他、フェライト系、鉄ー希 50 ン型スパッタ装置等で連続して形成できる。また、これ 11

らの保護膜は、単層としてもよく、あるいは、同一又は 異種の膜からなる多層構成としてもよい。上記保護層上 に、あるいは上記保護膜に替えて、他の保護層を形成し てもよい。例えば、上記保護層上にテトラアルコキシラ ンをアルコール系の溶媒で希釈した中に、コロイダルシ リカ微粒子を分散して塗布し、さらに焼成して酸化ケイ 素(SiO<sub>2</sub>)膜を形成してもよい。この場合、保護膜と凹 凸制御層の両方の機能を果たす。

【0035】潤滑層としては多種多様な提案がなされているが、一般的には、液体潤滑剤であるパーフルオロポ 10 リエーテルをフレオン系などの溶媒で希釈し、媒体表面にディッピング法、スピンコート法、スプレイ法によって塗布し、必要に応じて加熱処理を行って形成する。 【0036】

【発明の効果】本発明の結晶化ガラスは、容易に成形す ることができ、140GPa以上大きなヤング率及び800℃以 上の高い耐熱性を有し、かつ硬度や強度も大きい。さら に、本発明の結晶化ガラスを用いて、優れた表面平滑性 (表面粗さRa<1.0nm)を有する基材等を得ることも でき、基板材料や電子部品用材料として好適である。ま た、本発明の結晶化ガラスは耐熱性に優れるため、これ を用いた磁気ディスクは、磁気膜の特性向上に必要な熱 処理を基板の変形無しに施すことができる。さらに、本 発明の結晶化ガラスを用いた磁気ディスクは、平坦性が 優れるため、磁気ヘッドの低浮上化、即ち高密度記録化 に最適であり、かつヤング率や強度が大きいので、磁気 ディスクの薄型化及び高速回転化を達成できると共に磁 気ディスクの破損も避けられる。さらにガラスとしても 比較的安定に得ることができ、工業的規模での生産が容 易であるため、安価な次世代磁気記録媒体用基板ガラス 30 として大きく期待できる。また、本発明の情報記録媒体 は、高いヤング率を有し、強度、耐熱性が高く、表面平 滑性や表面均質性に優れ、かつ安価に製造できる結晶化 ガラス基板を用いるので、基板の高回転時においても振 動を少なくすることができ、特にサーバー等の高性能の

ハードディスクドライブに好適に用いることができる。 【0037】

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明の詳細を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。表1には実施例のガラス組成をモル%で示した。これらのガラスを溶解する際の出発原料としては、SiO2、Al2O3、Al(OH)3、MgO、CaCO3、Y2O3、TiO2、ZrO2、Li2CO3などを用いて表1に示した所定の割合に250~300g秤量し、十分に混合して調合バッチと成し、これを白金るつぼに入れ、1550℃で撹拌しながら空気中4~5時間ガラスの溶解を行った。熔融後、ガラス融液をサイズ180×15×25mmのカーボンの金型に流し、ガラスの転移点温度まで放冷してから直ちにアニール炉に入れ、ガラスの転移温度範囲で約1時間アニールして炉内で室温まで放冷した。得られたガラスは顕微鏡で観察できる結晶が析出しなかった。

【0038】180×15×25mmサイズのガラスを1  $0.0 \times 1.0 \times 1.0 \text{ mm}$ ,  $1.0 \times 1.0 \times 2.0 \text{ mm}$ ,  $1.0 \times 1.0 \times$ 20㎜に研磨した後、熱処理炉に入れ、表1に示した第 一次熱処理温度(核形成温度)まで3~10℃/分の昇 温速度で昇温し、当該温度で2~15時間程度保温し第一 次熱処理を行い、第一次熱処理を終えた後直ちに第一次 熱処理温度から表1に示した第二次熱処理温度 (結晶化 温度)までに3~10℃/分の昇温速度で昇温し、1~5時 間程度保温した後、炉内で室温まで冷却することによっ て結晶化ガラスを作製した。得られた結晶化ガラスをさ らに長さを95㎜に研磨してヤング率、比重の測定サンプ ルとした。ヤング率の測定に用いたサンプルをさらに切 断し、25mm×2mm×15mmのサイズに精密研磨して表面粗 さ測定用サンプルとした。ヤング率の測定は95×10× 10mmのサンプルを用いて超音波法で行った。測定で得 られたデータをガラスの組成と共に表1に示した。

[0039]

【表1】

# 実施例結晶化ガラス組成とその物性

ガラス成分(モル%)	1	2	3	4	5	8
SiO2	52.00	48.00	52.00	48.00	47.00	42.00
Al2O3	4.00	4.00	2.00	4.00		
MgO	34.80	34.60	38.50	42.00	42.00	40.00
Y203	1.00	1.00	1.00	1.00	2.20	5.00
TiO2		4.00			6.80	6.50
ZrO2	5.70	5.70	6.00	5.00		<u>3.</u> 50
Li2O	2.50	2.50	2.50			
N=20					1.00	2.00
. K20					1.00	1.00
検形成温度(℃)	760	750	765	815	725	730
核形成時間(Hr)	4	4	4	4	8	8
結晶化温度(℃)	1000	1000	1000	1000	950	950
結晶化時間(Hr)	. 4	4	4	4	4	4
表面粗さRa(nm)	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
ヤング率(Gpa)	145	150	145	150	. 162	185

【〇〇4〇】表面粗さの測定は原子間力顕微鏡(AFM) を用いて表面観察を行った。サンプル表面中3~5個所あ たり5×5μmの視野中の算数平均粗さを算出した。勿 論表面粗さは研磨条件や熱処理条件によって違うが、図 1には、表1に示した熱処理条件で熱処理した実施例4 の結晶化ガラスを光学ガラスの研磨工程で研磨した後の AFM写真を示す。実施例4の表面粗さは約0.5nmと小さく 次世代磁気ディスクの表面平滑性に対する要求に十分に 30 【表2】 対応できる。さらに熱処理条件や研磨条件を最適化すれ\*

\* ば表面平滑性のもっと優れた結晶化ガラスの作製が可能 である。

【0041】なお、比較のため、特開平1-23903 6号に開示されたイオン交換ガラス基板と米国特許第25 16553号に記載されたガラス基板とをそれぞれ比較例 1、2として、表2に組成と特性を記載する。

[0042]

#### 比較例の組成及び特性

<b>比較例</b>	1 .	2		
	化学強化ガラス	市販TS-10結晶化ガラス		
酸化物	特開平1-239036	米国特許第2516553		
SiQ2	73,00			
Al2O3	0.60			
CaO	7.00			
Na2O	9.00			
K20	9.00			
ZnO	2.00			
ヤング率(GPa)	79.00	90-100		
表面粗さRa(nm)	12.00	10-35		

16

1.5

【0043】表1から明らかなように、本発明の実施例ガラス基板はヤング率(140-200Gpaの範囲)が大きいことから、磁気記録媒体用基板として使用した場合、このガラス基板が高速回転しても、基板に反りやブレが生じにくく、より基板の薄型化にも対応できることが分かる。さらに、これらの結晶化ガラスは、表面粗度(Ra)を0.5nm以下に研磨することができるので、ガラス基板とした場合、平坦性に優れ、磁気ヘッドの低浮上化を図り得る磁気記録媒体用ガラス基板として有用である。これに対し、比較例1の化学強化ガラス基板は、表面平滑性及び平坦性に優れているものの、耐熱性及びヤング率などの強度特性で本発明のガラス基板に比べかなり劣る。従って、磁気記録媒体を製造する際、高い保磁力をなめに行う磁気層に対する熱処理が十分できず、高保磁力を有する磁気記録媒体が得られないし、また、比

較例1のガラスには多量のアルカリを含有するため、磁気膜と基板とのコロージョンが生じやすく、磁気膜にダメージを与えるおそれがある。また、比較例2の結晶化ガラス基板は、ヤング率や比弾性率及び平滑性の点で本発明のガラスに比べ劣る。特に基板の平滑性が大きな結晶粒子の存在によって損なわれるので、高密度記録化を図ることが難しい。

【0044】本発明の結晶化ガラスは、高ヤング率を有し、かつ優れた表面平滑性も有することから、磁気記録 10 媒体等の情報記録媒体用の基板として非常に有用であることが分かる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 熱処理した実施例4の結晶化ガラスを光学ガラスの研磨工程で研磨した後の状態を示す図面に変わる AFM写真。

[図1]



実施例4の原子間力顕微鏡写真

# フロントページの続き

Fターム(参考) 4G062 AA11 AA18 BB01 CC10 DA05 DAO6 DBO1 DBO2 DBO3 DC01 DC02 DC03 DD01 DD02 DD03 DEO1 DEO2 DEO3 DFO1 EA01 EA02 EA03 EB01 EB02 EB03 ECO1 ECO2 ECO3 EDO4 EDO5 EE01 EE02 EE03 EF01 EF02 EF03 EG01 EG02 EG03 FA01 FB01 FB02 FB03 FB04 FC01 FCO2 FCO3 FDO1 FEO1 FF01 FG01 FG02 FG03 FH01 FH02 FH03 FJ02 FJ03 FK01 FL01 FL02 FL03 GA01 GA10 GB01 GCO1 GDO1 GEO1 HHO1 HHO3 нно5 нно7 нно9 нн11 нн12 HH13 HH15 HH17 HH20 JJ01  $\rm JJ03\ JJ04\ JJ05\ JJ07\ JJ10$ KK01 KK03 KK05 KK07 KK10 MM27 NN31 NN33 NN40 QQ02 QQ06 5D006 CB04 CB07 DA03 FA00 FA04